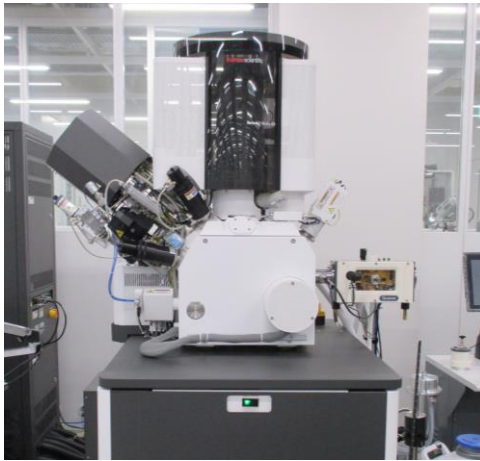


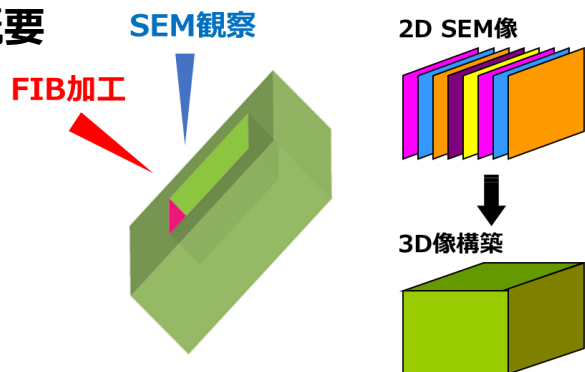
# マルチプラズマFIB-SEM 高い位置精度で広範囲の断面加工、大領域での三次元観察が可能

## 装置外観



Thermo Fisher Scientific製  
Helios5 Hydra UX

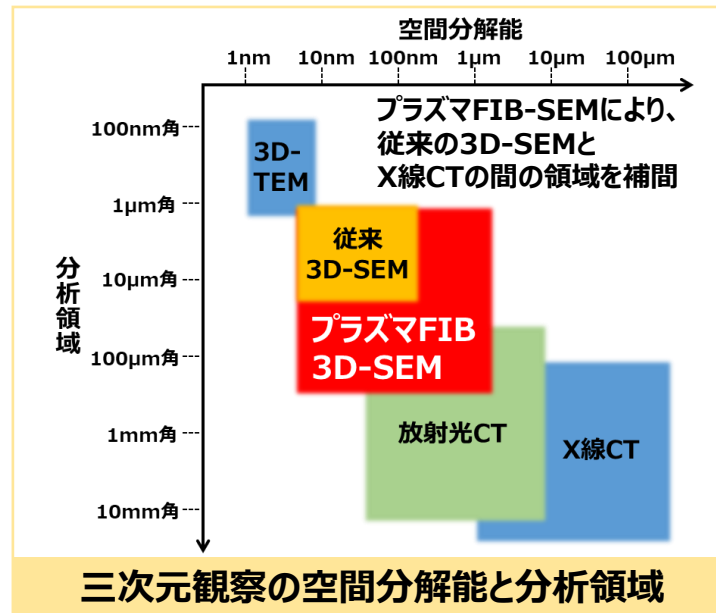
## 概要



## 特長

- 従来のGaイオンと比較して高い電流値(最大40倍)での加工が可能となり、短時間で広範囲の断面作製を実現  
(同一面積で比較すると加工時間が1/5~1/10に短縮)
- Gaイオンでは困難であった大領域での三次元観察に対応可能
- イオン種を切り替えることで、材料に最適な断面加工条件を選択可能
- クライオシステムの搭載により、ソフトマテリアルからハードマテリアル、それらの複合材料の分析に対応

※FIB-SEM : Focused Ion Beam-Scanning Electron Microscope



## FIB仕様

イオン種 : Xe、Ar、O、N  
FIBの電流範囲 : 1.5 pA~2.5 µA  
加速電圧範囲 : 500 V~30 kV  
最大観察横幅 : 0.9 mm

## 用途例

- エネルギーマテリアル (LIBや燃料電池用の部材)
  - 多孔構造の連通性、各種移動パス
  - 繊維配向性
  - フィラー分散性
- など